



Mini-BENCH

研究開発用 超高温カーボン実験炉『Mini-BENCH(ミニベンチ)』

C/C composite, Tungsten element high-temperature furnaces



【Mini-BENCH】

超高温小型実験炉 Max2000℃

大学・研究機関向け、基礎実験用途の小型卓上実験炉。
コンパクトサイズ・簡単操作 2000℃まで急速昇温！
SiC・GaN デバイス基礎研究、新素材・新材料開発、他
先端基礎研究、製品開発などで幅広く活用いただけます。

- 最高使用温度：Max2000℃ (Ar, 真空中)
- 試料サイズ：Φ1inch～Φ4inch
- ヒーター素線：C/C コンポジット，タングステン
- プロセスガス：Ar, N2, H2, etc..



【Mini-BENCH-prism】

セミオート式 超高温実験炉 Max2000℃

PLC セミオートコントロール 卓上型 Mini-BENCH の
セミオート制御式上位機種
「真空引き」「ベント」の電気炉操作を自動シーケンス制御
(* ガス流量はニードルバルブ手動調整)
冷却水異常・チャンバー温度異常・過圧異常を監視。

- 最高使用温度：Max2000℃ (Ar, 真空中)
- 試料サイズ：Φ1inch～Φ4inch
- ヒーター素線：C/C コンポジット，タングステン
- プロセスガス：Ar, N2, H2, etc..



Product Update

Mini-BENCH

卓上型実験炉 (手動操作)



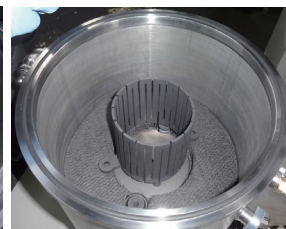
【Φ1inch用チャンバー(最小)】



【Φ3, 4inch用チャンバー(最小)】



【フラットエレメント】



【円筒状エレメント】

Mini-BENCH-prism

セミオート式実験炉 (真空/パーズ, ベント自動制御)



【フラットエレメント】



【グラファイトるつぼ】

装置寸法: 幅603 x 奥行603 x 高さ1,160 mm